Kérdések

Definíciók, szakkifejezések

aspect ratio: A furat méretaránya (átmérő/hossz). Jellemző érték a fúrószár terhelhetőségére és a furat fémezhetőségére.	stencil: Apertúra nyílásokkal rendelkező vékony fémlemez. Felhasználása a nyák gyártásban: Különböző rajzolatok felvitele (forrasztópaszta, forrasztásgátló lakk, maratásgátló maszk).	AOI: Automatical Optical Inspection. Számítógép segítségével végzett, képelemzésen alapuló ellenőrző eljárás. Nyák gyártásnál a panel elkészülte után a nyák vizsgálatára szolgál.	step and repeat: Ismétlő levilágítás. Adott rajzolat többszöri levilágítása az adott felületre. Nincs maszk-panel kontaktus, olcsó.
mesh: A szita finomságára jellemző érték. Megadja az egy inchen belül található csomók számát (csomó/inch).	Faraday állandó: Egy mól elektron töltésének abszolút értéke (F=96500 C/mol).	additiv technológia: Szigetelő hordozóra adott rajzolat szerinti fémréteg növesztés (PI.: immerzió, majd galvanikus rezezés).	direct plating: Furatfémezés. A hordozón kialakított Pd rétegre közvetlenül, galvanizálás segítségével visszük fel a szükséges vastagságú réz réteget.
előhívás: A redukció teljessé tétele a fényt kapott szemcsékben (nyák gyártásnál permetezéssel vagy merítéssel, anyaga híg lúg).	prepreg: Félig kikeményített, üvegszövettel erősített epoxigyanta, a hordozó anyagával megegyező anyag. Többrétegű nyákgyártás során a vezetőrétegeket tartalmazó hordozók elválasztására szolgál.	szubtraktív technológia: A hordozóra felvitt réteget az adott rajzolat szerint eltávolítjuk a felületről, ezzel kialakítva a rajzolatot.	fotostencil: Indirekt módon, fotoreziszt segítségével létrehozott maszk. A fóliát a szövetbe hengerlik, majd a felesleges fóliát meleg víz segítségével leoldják a felületről.
mil: Angolszász hossz mértékegység. Az inch ezredrésze (0,0254mm).	dekapírozás: Felületi oxidréteg, illetve más korróziós bevonat eltávolítása fém tiszta állapotig. Általában savas oldatokkal (10-20%-os kénsav, sósav).	flip chip: A chip felületén dudorok kerülnek kialakításra. Ezek segítségével történik a chip kontaktusainak kialakítása. A chipet felragasztják a felületre, ezzel rögzítveés biztosítva a villamos vezetést. Olcsó, de rossz a hővezetés.	strippelés: A fotoreziszt felhasználás utáni eltávolítása a felületről, erős lúg segítségével (Pl.: 5%-os NaOH).

galvanoplasztika: Elektrolizálás forgó acélhengerre, fél fordulat után lefejtés. Nyák gyártás során felhasznált rézfólia előállítására alkalmas.	túlfeszültség: Az elektród polarizáció jelenségénél, az egyensúlyi potenciálhoz képest mérhető potenciálkülönbség.	poliimid: Nyák gyártás során a hordozó anyagaként felhasznált nagy hőállóságú polimer (-230 foktól +370 fokig).	black hole: Fémezési eljárás. A hordozóra először grafit réteget viszünk fel, majd erre galvanizáljuk a szükséges rezet.
ENIG: Elektroless Nikkel Immersion Gold. A rézfelületre felvitt nikkel rétegre külső elektromos energia nélkül (immerzióval) történő aranyréteg képzés.	HASL: Hot Air Solder Level. Forraszba mártás segítségével forrasztott nyák esetén a felesleges forraszanyag eltávolítására szolgáló technológia. A panelt forró levegővel tisztítjuk meg.	nyitás/zárását a gépi ábrakészítésnél.	antisztatikus anyag : A műanyagok elektromos feltöltődését csökkentő, megszüntető anyagok. Nagy a felületi ellenállásuk.
alámarás (rajz is): Megmutatja, hogy a maratószer mekkora arányban távolítja el a maszk alatt lévő vezető réteget, a vezető réteg vastagságához képest.	felületi ellenállás: A szigetelőanyagra fektetett 2 db 100 mm hosszúságú egymástól 10 mm távolságra levő párhuzamos elektród között mért ellenállásérték.	fémmagos (metal core) hordozó: Vékony fémlap és szigetelőanyag felhasználásával készült, nagyon jó hővezető képességű hordozó. A fémlap jellemzően Al vagy Cu.	thermal via: Hőelvezetést szolgáló via
pick and place: A beültető gépek egy típusa, amely az alkatrész megfogása után elhelyezi azt a panelen. Létezik egy és többfejű. Pontosság: 10-20 um.	intermetallikus réteg: A forrasztás során két fém között létrejövő fémközi elegy. Ez biztosítja a kapcsolatot a két fém között. Réz és ón esetén Sn5Cu6.	nedvesítési szög: A forraszanyag felülete és a hordozó közötti szög. Nagysága meghatározza a forrasztás minőségét (minél kisebb annál jobb a nedvesítés és a minőség).	flux: Folyasztó szer. Az oxid réteg feloldásával segíti a forraszanyag szétterülését. Hatása: jobb nedvesítés, jobb minőségű forrasztás. Alkotóelemei: gyanta, oldószer, aktiválószerek.
RoHS: EU-s szabvány az elektronikai termékekben felhasznált veszélyes anyagok korlátozására. Tiltja az ólom, higany, króm, bróm tartalmú lánggátló és a kadmium felhasználását.	műveleti ablak: Egy technológiai lépés optimális paramétereinek értéke körüli megengedett szórás. Minél nagyobb az ablak, annál stabilabb a technológia, annál nehezebb rontani.	rework: A kész panel ellenőrzésekor felmerülő hibák utólagos javítása.	

TK (R): Az ellenállás paszták pontosságát jellemző érték (ppm).	sírkő jelenség: Forrasztási hiba. Az alkatrész két kivezetése közül az egyik nem jól kerül rögzítésre, így feláll az egyik fele.		
lift-off: Fordított rezisztmaszkos eljárás. Ezen eljárás folyamán a tiszta hordozón fotorezisztből alakítjuk ki a negatív ábrát, majd erre gőzöljük a réteget.	ITO: Vezető anyag. Az inídium, ón és oxigén vegyülete (In2O3SnO2)	szabad úthossz: Megadja, hogy a párologtatott, porlasztott ion mekkora távolságot tesz meg az adott környezetben, anélkül, hogy ütközne egy másik részecskével.	PVD: Physical Vapour Deposition. Hagyományos módszerekkel történő vákuumtechnikai rétegleválasztások (Pl.: katódporlasztás, vákuumpárologtat ás, elektronsugaras gőzölés). Főként kontaktusfémezésr e használják.
plazma: Ritkított térben, két elektróda között létrehozott önfenntartó villamos kisülés.	üvegkerámia:	HTCC / LTCC: Magas (1600 fok) és alacsony (850 fok) hőmérsékletű kiégetés. Többrétegben tartalmazhat eltemetett passzív elemeket, továbbá felszínén kialakítható aktív vastagréteg integrált áramkör. Furatok készítése csak nyers állapotban lehetséges.	MCM: Multi Chip Module. Kerámia vagy üveg hordozón, több chipet, vékony és vastagréteg áramkört tartalmazó integrált áramkör. Lehet laminált (MCM-L), kerámia (MCM-C) és vékonyréteg technológiájú (MCM-D, deposited).
Ablaknyitás: A rajzolat kialakításához felhasznált eljárás. A rajzolat területén az Si felszín szabaddá tétele, reziszt felvitele, exponálás, előhívás, SiO2 marása, reziszt eltávolítása.	nedves oxidáció: Oxidáció elősegítése vízgőz jelenlétével.	izotróp marás: MEMS technológiáknál alkalmazott réteg maratási módszer. Térbeli iránytól független, gyökökkel történő marás. Használata nagy felületek esetén a felső réteg eltávolítására.	hetero-epitaxia: Rétegnövesztési eljárás, mely során különböző, de hasonló rácsállandójú anyagot építünk be.

homo-epitaxia: Rétegnövesztési eljárás, mely során azonos anyagot, de bizonyos tulajdonságok megváltoztatásával építünk be.	Knudsen cella: MBE molekulasugár epitaxia során felhasznált cella. Több forrás használata. Nagyon pontosan szabályozható atom vagy molekulasugár.		szegregáció (zónás tisztítás): A szennyezőanyagnak nagyobb az oldhatósága az olvadékban, mint a szilárd fázisban. Pl. zónás tisztítás folyamán feldúsul a rúd végén.
		HOMO, LUMO szint: A polimer elektronikában a kötő pályát (HOMO, legfelső betöltött molekulapálya, megfelel a vegyérték sávnak) és a nemkötő pályát (LUMO, legalsó betöltetlen molekulapálya, megfelel a vezetési sávnak) jelentő kifejezés.	roll-to-roll: Egy soron egymás után az összes technológiai lépés elvégezhető. A gyártás során nincs szükség különböző gépekre.

1. NYHL szigetelő hordozóinak anyagai, típusai, jellemző tulajdonságai.

Anyagai: Szálerősített, hőre nem lágyuló műgyanta. Az erősítő anyag üvegszál, papír vagy szálas kerámia.

Típusai: Merev és hajlékony.

Jellemző tulajdonságai: Nagy szakítószilárdság, nedvességtűrés, lángállóság.

2. <u>Miért alkalmas, (előnyös) a NYHL áramköri modulok alapjaként?</u>

Felváltotta a különálló kábeleket, egy helyen megvalósítható a kapcsolat az eszközök között, egyszerűbben lehet összekötni a sűrű elektromos alkatrészeket. A hőelvezetés is fontos szempont.

3. Melyek a hordozóval szemben támasztott fontosabb követelmények?

Megtartsa a komponenseket a szerelés és a használat során, szilárd legyen, ne vetemedjen.

Legyen jó szigetelő, nagy fajlagos és felületi ellenállás, kicsi relatív dielektromos állandó, kis veszteségi tényező nagy frekin is.

Vezesse el, ossza szét, adja le a keletkezett hőt.

Viselje el a gyártás és a használat során fellépő hőterhelést.

Legyen kicsi a hőtágulása.

Fúrható, darabolható legyen.

A szigetelő felület fémezhető legyen.

Álljon ellen a technológia során használt vegyszereknek.

Minimális legyen a vízfelvétele.

4. <u>Milyen termikus jellemzőket kell ismernünk a hordozóról, mi ezeknek a</u> jelentősége?

Tg transzformációs hőmérséklet: Ezzel jellemezhető a hordozók hőállósága. Nem kristályos anyagoknál (polimer, üveg) az a hőmérséklet, ami alatt az anyag rideg, szilárd, fölötte fokozatosan lágyul és nagy viszkozitású olvadékként viselkedik. Tg fölött még használhatók a polimerek, kezdetben rugalmasan deformálhatók, de a hordozók esetében ezt megakadályozza az üvegszövet erősítő. Csökken a mechanikai szilárdság, romlik a mérettartás.

5. A NYHL felület-előkészítési eljárások célja, módszerei.

Mechanikai tisztítás

Cél: Miközben a réz felületét is alakítja, érdesíti, a felületi szennyeződést is eltávolítja. Módszerek:

- o Kefés tisztítás: Hengerekből álló tisztítógépekben (nylon sörtés kefe, tömör kefe).
- Habköves, alumíniumoxidos tisztítás: A habkő egy szilikát ásvány, porózus, jó koptató hatású tisztító anyag. Készíthető kézzel (kefe), géppel (dörzshengerhez hasonló, de lágyabb sörtéjű kefék), habkősugár géppel (habkövet tartalmazó vízsugár).

Zsírtalanítás

A fotoreziszt fólia, galvanizált fém egyenletes tapadásának feltétele, hogy a felület zsírtalan legyen. Leggyakrabban lúgos zsírtalanítókkal. Ez lehet híg nátrium-klorid vagy szóda. Alapos öblítés követi.

Mikromarás

Cél: A felület finom érdesítése, a következő réteg jobb tapadásáért. Legyakrabban ammónium-perszulfáttal vagy nátrium-perszulfáttal. A kisebb marási sebességet a hígabb 10-15%-os oldat biztosítja.

Oxidmentesítés (dekapírozás)

Cél: A réz felületi oxidációjának eltávolítása, hogy ne okozzon rövidzárat vagy szakadást. Leggyakrabban 10%-os kénsavval, ritkábban sósavval.

6. Fúrás: a folyamat jellemzői, a fő követelmények

A kialakítás módjai: gépi fúrás, lézeres furatkialakítás, plazmamarás, kémiai marás, lyukasztás. A gépi fúrás a legelterjedtebb. Általában több panelt raknak egymásra és egyszerre fúrják át. A fúrófej wolfram-karbid. Igen kicsi furatok kialakítása (0,3-0,8-1mm). Az átlagosan 0,5-1m nagyságú táblán tartani kell a közel 0,1m-es pontosságot, sok táblán egymás után is. Cél az egyenletes és sima falú furat kialakítása. Ennek feltétele az éles fúró, a nagy fordulatszám és az, hogy a műanyag a felületén ne melegedjen fel annyira, hogy meglágyuljon. A legalsó réteg egy vékony pozdorja lemez, amely megakadályozza a sorja képződést, legfelül pedig az Al fólia található. Az alsó lapnak az is a szerepe, hogy a fúrófej ne a fém munkaasztalba érkezzen a művelet végén.

7. <u>A rézfólia előállítása, felvitele a hordozóra. A szokásos vastagságok. Mikor milyent választunk? Mi szabja meg a minimális csíkszélességet?</u>

A szigetelőrétegen lévő réz vastagsága 10 és 100 mikron között változhat, de általában a 18, 35 és 70 mikron rézvastagságú kártyák az elterjedtek. Ezt a rézréteget laminálással viszik fel a szigetelőkártyára. Magát a rézfóliát galvanoplasztikai eljárással készítik (elektrolizálás forgó acélhengerre, fél fordulat után lefejtés). Minél vastagabb a fólia annál kevesebb hiba keletkezhet. A vastagabb rétegnek nagyobb a tömege a rézréteg befedésére és a rásimuláshoz. A vastagabb film kevésbé hajlamos megsérülni különféle szennyeződésekre, hulladékokra vagy a dolgozók rossz kezelésének hatására. A vastagabb film viszont csökkenti a felbontóképességet, növeli a megvilágítási, előhívási és strippelési időt. Az átvinni kívánt áramerősség/feszültség, frekvencia, alkatrészsűrűség és a vezető anyaga határozza meg a csíkszélességet.

8. <u>A vezetőcsík vastagságának, szélességének megválasztása/tervezése. Milyen szempontok szabják meg? Mi határozza meg a vezetők közötti szigetelőcsík szélességét?</u>

A vezetőcsík vastagsága, szélessége függ:

- a terheléstől (hőmérséklet, áramerősség)
- a rajzolatfinomságtól, az alámarástól
- a vezetőcsík ellenállásától

A szigetelőcsík szélességét az alkalmazott feszültség határozza meg.

9. Milyen eljárásokkal lehet vezetővé tenni a furatokat?

Redukciós rezezés, black hole, direct plating.

10. Mi a mikrovia, hogy készíthető?

Többrétegű kártyák esetében fémesen köti össze a rétegeket. Készíthető lézeres fúrással vagy plazmamarással. Átmérő 10-100um.

11. <u>Mi a furat méretarány (aspect ratio), mi szabja meg a korlátait átmenő furat és</u> mikrovia esetén?

furat hossza/átmérő arány. Átmenő furat esetén a panelek össz vastagsága határozza meg, mikrovia esetén a mélység.

12. A via-feltöltés célja, módjai

Célja a helytakarékosság. A feltöltést általában műgyantával vagy galván rézzel oldják meg.

13. <u>Furatok, viák a NYÁK gyártásban; típusok, fúrási megoldások, fémezés menete, követelmények.</u>

Furatok szükségesek a lemezek mechanikai rögzítésére, a rétegek illesztésére, pozícionálására, a furatba szerelhető alkatrészek beültetésére. A két és többrétegű kártyákon a rétegek közötti összeköttetést vezető furatok, viák biztosítják. Furatok kialakítási módjai:

Gépi fúrás

Ez a legelterjedtebb. A viák készítése leginkább így történik. A folírozott lemezek fúrása több szempontból különbözik a hagyományos fúrási eljárásoktól. A lemez anyaga nem homogén, a viszonylag lágy műgyanta mellett a kemény, erősen koptató hatású üvegszövet található, kívül pedig a réz. A furatok átmérője igen kicsi, az alsó határ ~0,2 mm alatt van, de 0,8 - 1 mmnél szinte soha nem nagyobb. Az átlagosan 0,5 - 1 m nagyságú táblán tartani kell a közel 0,1 mm-es pontosságot, méghozzá sok táblán egymás után is. A fúrófej anyaga wolfram karbid. Ez kellően kemény, kopás- és hőálló anyag, de meglehetősen rideg. Célunk egyenletes és sima falú furat létrehozása. Ennek feltétele az éles fúró, a nagy fordulatszám, és az, hogy a műanyag a felületén ne melegedjen fel annyira, hogy meglágyuljon, kenődjön. Egy epoxi üveg hordozó esetében a hőmérséklet nem haladhatja meg a 110Co-ot. A jobb hőelvezetést a kártyák fölé helyezett alumínium fóliával lehet biztosítani. Általában több panelt raknak egymásra és egyszerre fúrják át. Az aspect ratio adja meg az egyszerre fúrható rétegek számát.

- Lézeres furatkialakítás
- Plazmamarás
- Kémiai marás
- Lyukasztás

A lyukasztás a legegyszerűbb mód. A szerszám alsó részét a lemezhez illesztjük és a lyukasztófej erős lenyomásával vágjuk ki a nyílást. Szükség esetén nem csak kör, hanem négyszögletes, vagy ovális formában tudunk így lyukakat készíteni. Illesztő, pozícionáló, szerelő lyukak készítésére alkalmas módszer. A furatfal alkalmatlan a fémezésre, ezért via így nem készíthető.

Fémezési eljárások (több szakaszban végezzük):

Redukciós rezezés

A szigetelő felületre (furat belső fala) kémiai redukcióval nagyon vékony (0,5-1um) rézréteget választunk le.

Panelgalvanizálás

A már vezető felületen (és a panel teljes felületén) galvanikusan vastagítjuk a rézbevonatot, kb. 5-8um-ig.

Rajzolatgalvanizálás

Negatív maszkolás és előhívás után csak az áramköri ábra és a furatok maradnak szabadon, ezen a felületen tovább vastagítjuk a fémréteget, kb. 15um réz és kb. 5-10um ónréteg galvanizálásával.

14. <u>A foto készítésének lépései. Mi történik a filmen a kép elkészülte alatt (nem a kémiai reakciók kellenek)?</u>

Szerepe a minta átvitele. Mesterábra készíthető kézzel (tusrajz, sablonkészlet) és géppel (áramkörtervező vagy nyhl tervező program).

15. <u>Mi a fotorezisztek működésének alapja? Milyen típusai vannak? Rövid</u> jellemzés!

Megvilágítás hatására megváltozik az oldhatósága, ellenálló-képessége valamilyen oldószerrel (előhívóval) szemben. Működési módjuk szerint lehetnek pozitív vagy negatív rezisztek, aszerint, hogy az eredeti ábrát vagy az ellentettjét kapjuk a megvilágítás után.

16. <u>Pozitív fotorezisztek tulajdonságai. Hogy alkalmazom, ha egy maratásálló</u> maszkot akarok készíteni egyoldalas lemezen? (lépések leírása indoklással)

A megvilágítás hatására a polimer molekulák feltöredeznek, ezeknek a területeknek az oldhatósága jelentősen megnő. UV-ra érzékeny, a látható tartományban nem. Exponálása bármilyen UV lámpával lehetséges, de ajánlott nagynyomású higanygőz-lámpa (365nm). Előhívása híg NaOH oldattal (5g/l), de figyelni kell mert érzékeny a túlhívásra. A strippelés szerves oldószerrel (pl. alkohol) vagy töményebb NaOH-al történik.

17. <u>Negatív fotorezisztek tulajdonságai. Hogy alkalmazom, ha egy maratásálló</u> maszkot akarok készíteni egyoldalas lemezen? (lépések leírása indoklással)

A megvilágítás hatására láncmolekulák összekapcsolódnak, térhálósodnak, ezeknek a területeknek az oldhatósága jelentősen lecsökken. UV-ra és a rövidebb hullámhosszú látható fényre érzékeny (~540nm alatt). Exponálása bármilyen UV lámpával lehetséges, de ajánlott nagynyomású higanygőz-lámpa (365nm). Előhívása 1-2%-os Na2CO3 oldattal történik, túlhívásra nem érzékeny. A strippelés 5%-os NaOH-al történik.

18. <u>Maszkkészítés szitanyomtatással és fotolitográfiával. A két módszer összehasonlítása, mikor melyik alkalmazása előnyösebb?</u>

Szitanyomtatás:

- Lényege, hogy a kifeszített szitaszövetnek (ragasztás, önfeszítő mechanizmus) a rajzolat szerinti területét hagyjuk szabadon, a többit egy maszkkal átjárhatatlanná tesszük. Így a szitára felrakott festéket egy kenőkéssel áthúzva, a festék a szabad lyukakon átjut és a minta átkerül a hordozóra.
- A forrasztásgátló lakk felvitelére, a maratásálló maszk elkészítésére, a forrasztópaszta felvitelére, a fotoreziszt felvitelére vagy feliratok készítésére is használják.

Fotolitográfia:

- Az ábra átvitele valamilyen fényérzékeny réteg segítségével, fototechnikai úton történik. A fényérzékeny anyag (fotoreziszt) oldhatósága és ellenálló-képessége megváltozik a megvilágítás hatására valamilyen oldószerrel (előhívóval) szemben.
- Előnye a szinte korlátlan felbontóképesség. 100um alatti finomságú NYÁK rajzolattól kezdve a 10nm közeli félvezető áramköri elemek maszkolására is alkalmazható.
- Lehet pozitív és negatív.

19. <u>Mi a különbség és mi a hasonlóság a pozitív és a negatív fotorezisztek között?</u>

Hasonló az exponáláshoz szükséges fényforrás. A különbség a megvilágítás hatására végbemenő folyamat és a végeredmény.

20. Hogy épül fel a száraz-reziszt fólia? Miért volt szükség a kifejlesztésére?

Polietilén fedőréteg, Riston fólia, polietilén védőfólia. Kevesebb technológiai lépéssel meg lehet valósítani, egyenletes rétegvastagsággal. Többrétegű kártyák gyártását teszi lehetővé, nem folyik be indokolatlan helyekre a reziszt.

21. <u>Ismertesse a fotoreziszt anyagok rétegfelvitelének módjait! Rövid leírás,</u> értékelés.

Fotolitográfia Szitanyomtatás Laminálás Permetezés Folyadékfüggöny

22. <u>Ismertesse a folyékony fotorezisztek rétegfelviteli módjait, azok előnyeit, hátrányait!</u>

Permetezés

A folytonos függönyt képező folyadékon keresztül nagy sebességgel átlövik a lemezeket, miáltal egy adott vastagságú egyenletes bevonat keletkezik. Minden rétegfelvitelt szárítás követ. Ha a gyártó nem ír elő más paramétereket, a szokásos szárítás 80°C-on 10 percig tart.

- Szitanyomtatás
- Hengerelés
- Centrifugálás

23. <u>A lézeres levilágítási megoldások bemutatása, előnyök, hátrányok. (fotoreziszt megvilágításnál)</u>

Érintkezéses levilágítás

Előnyök: bejáratott, kipróbált eljárások; olcsó, könnyen beszerezhető eszközök; nagy áteresztőképesség

Hátrányok: relatív alacsony kihozatal; pontatlan helyezés, pozícionálás; kis felbontás; maszk kopás; szemcsés szennyezés veszélye

Lézeres vetítő módszer

Előnyök: nagy felbontás nagy felületű hordozón is; nagy pontosságú helyezés, pozícionálás; nagy áteresztőképesség hagyományos rezisztekkel; nincs maszk-panel kontaktus → magas kihozatal; viát lehet vele fúrni polimer rétegbe

- Lézeres közvetlen levilágítás

Előnyök: nincs szükség maszkra; kis sorozatú gyártásra ideális; nagy pontosságú helyezés, pozícionálás; függetlenül beállítható X és Y irányú korrekciós skála → panel deformációkhoz alkalmazkodik; kiváló kihozatal

Hátrányok: különleges, negyérzékenységű és gyorsan exponálható rezisztet igényel; az áteresztőképesség függ a felbontástól

- Ismétlő levilágítás

Előnyök: nincs maszk-panel kontaktus → magas kihozatal; pontos helyezés; hagyományos rezisztek használhatók; olcsó

Hátrányok: a léptetés-helyezés-ismétlés módszer behatárolja az áteresztőképességet; korlátozott méret

24. A szitanyomtatás fő felhasználási területei

Eredetileg nyomdai technológia, de használják a nyák gyártásban és a vastagréteg IC-k készítésénél is. Pl. a forrasztásgátló lakk felvitelére, a maratásálló maszk elkészítésére, a forrasztópaszta felvitelére, a fotoreziszt felvitelére vagy feliratok készítésére is használják.

25. <u>A szitanyomtatás fő technológiai paraméterei; hogy befolyásolják a nyomtatott rajzolat minőségét?</u>

- szakítószilárdság: az erősebb anyagból vékonyabb szál is elég, tehát finomabb szita szőhető
- kopásállóság: a szövet élettartamát határozza meg. A forraszpaszta, a vastagréteg paszták olyan kemény szemcséket is tartalmaznak, amelyek a lágyabb poliészter szálakat nagyon hamar tönkretennék, ezért ezek csak acélszitán vagy acélstencilen (ld. később) nyomtathatók.
- rugalmasság: a poliészter szövet kifeszítve is mutat némi rugalmasságot, ezért ezt nyomtatáskor el lehet emelni a hordozótól és csak a kenőkés nyomja a felületre. Az acélszitának közvetlenül érintkezni kell a nyomtatandó felülettel, ezért másféle berendezést kell használni.
- kémiai ellenálló-képesség: A festékhígítók, oldószerek, tisztításhoz használt anyagok között több eléggé agresszív anyag is található, de ezeket mindkét anyag elég jól tűri.
- geometriai jellemzők: a szitafinomságot, az elérhető felbontóképességet az angolszász hagyományos mértékegység szerint "mesh"-ben adják meg, ami az egy inch-re jutó csomók száma. A NYÁK rajzolatokhoz általában 100 – 150 mesh-es szita megfelelő. Emellett fontos jellemző még a szabad felület aránya is, különösen akkor, ha a nyomtatandó réteg vastagsága is fontos paraméter.

26. <u>Ismertesse a fém stencilmaszkok előállítási elvét, előnyeit, hátrányait, alkalmazását.</u>

Fémfólián a kellő nyílások kivágása laserrel vagy maratással. Előnyei a nagyobb pontosság, a nagyobb felbontás és a nagyobb élettartam. A lézerrel kivágott pontosabb, nagyobb megbízhatóságú és nincs szükség vegyszer használatára sem.

27. <u>A direkt és indirekt szitamaszk készítés lényege, az így készült maszkok</u> jellemzői.

A direkt maszk készítésekor először a teljes szitafelületet bevonják egy fényérzékeny anyaggal (bemerítik a folyékony emulzióba, majd a rátapadt réteget beszárítják), és erre fotózzák rá a kívánt rajzolatot. A megvilágítás kontaktmásolással történik, a filmet rászorítják a szitára, és ezen keresztül UV fénnyel exponálják a szitát. Leggyakrabban poli-vinilalkohol alapú negatív fényérzékeny anyagot használnak, ebből következően pozitív filmet kell használni, és így a meg nem világított területek maradnak oldhatóak. Az "előhívó" ez esetben meleg víz. Végül szárítás után a szitán a rajzolatnak megfelelő területek lesznek átjárhatók, a többi nem.

Az indirekt maszknál a fényérzékeny anyagot fólia formában használják, először exponálnak és előhívják, majd még nedvesen belepréselik a szitaszövetbe. Száradás után a szita maszkon kívüli felületét tömítő festékkel ki kell kenni.

A két eljárás közül a direkt maszk valamivel erősebben kötődik a szövetbe, ezért ez tartósabb, 10 – 15 ezer nyomtatást kibír. Ezzel szemben az indirekt maszk készítése könnyebb, gyorsabb és kevesebb anyagot használ. A rajzolat pontosságában nincs számottevő különbség. A direkt maszk készítésénél lehetőség van többszöri bemártással a rétegvastagság növelésére, és ezzel a nyomtatandó réteg vastagságának növelésére. Ennek elsősorban a vastagréteg passzív elemek nyomtatásánál van jelentősége.

28. <u>Milyen tényezők szabják meg egy szitázott rajzolat pontosságát? A tényezőket fontosság szerint csoportosítsa!</u>

Az ábra pontossága, reprodukálhatósága a **nyomtatási paraméterek** (kenőkés nyomóerő, kenőkés sebessége, a kés dőlésszöge, szita és hordozó távolsága) pontos betartásától, a **szitamaszk** és a **festék** (megfelelően nagy felületi feszültség, megfelelő viszkozitás (nagy (áramlásnál) és kicsi (nyugalomban) egyszerre, tixotróp anyagok)) tulajdonságaitól függ.

29. <u>Milyen módszereket ismer fémbevonatok készítésére (folyadék fázisból)?</u> <u>Mikor melyik alkalmazható? Írjon példákat a NYÁK technológiából!</u>

- Redukciós fémezés (kémiai fémezés): Kémiai reakcióban egy redukálószer adja át a szükséges elektron(oka)t. Alkalmazás: szigetelő és vezető felületre, furatfémezés, ellenállás. Leggyakoribb: Cu, Ni, Ag, Pd.
- Galvanizálás (elektrolizálás): Villamos áram biztosítja a szükséges töltést. Alkalmazás: vezető felületre, panel, rajzolat érintkezők. Leggyakoribb: Cu, Ni, Au, Sn.
- Immerziós fémezés: Egy csere-reakcióban egy másik fémtől kapja meg a hiányzó elektron(oka)t. Alkalmazás: vezető felületre, árammentes ioncsere reakció, felületkikészítő rétegek készítése. Leggyakoribb: Au, Ag, Ni.

30. Fémbevonat készítés galvanizálással. A folyamat lényege, fő jellemzői.

A laborban megmértük a lemez oldalait és kiszámítottuk a panel felületét. Ezután a lemezt befogtuk a galvanizáló szerszámba, csapvízben leöblítettük majd fél percre a dekapírozó fürdőbe merítettük. Innen öblítés nélkül a galvanizáló kádba merítettük és katódként kapcsolva 1A/dm2 áramsűrűség mellett 25 percig galvanizáltuk folyamatos mozgatás mellett. Ekkor az elektrolit pozitív fémionjai a villamos tér hatására vándorolnak a katód felé, a felülethez érve pedig megkapják a hiányzó elektronokat, semleges atommá alakulnak és beépülnek a felületi rétegbe. A cellán átfolyó töltéssel arányos mennyiségű fém tud semlegesítődni, tehát ezzel szabályozható a rétegvastagság. Ezt írja le a Faraday törvény, amiből kiszámoltuk a kellő rétegvastagsághoz szükséges áramerősséget és időt. Réz, nikkel, ón, arany. A fürdő fő alkotói:

- a felvinni kívánt fém sója
- kénsav
- adalékanyagok
- nemesfémeknél lúgos, cianidos fürdő

31. Fémbevonat készítés immerziós módszerrel. A folyamat lényege, fő jellemzői.

Ez mindig egy csere reakció; egy kevésbé nemes fémet (negatívabb elektródpotenciálút) egy nemesebb fém oldatába merítjük. Az oldatban levő megkapja a szükséges elektronokat, redukálódik és semleges fémként kiválik a felületre. Arany, ezüst, nikkel.

32. <u>Fémbevonat készítés kémiai redukciós módszerrel. A folyamat lényege, fő</u> jellemzői.

Ennek az eljárásnak a legfontosabb előnye, hogy szigetelőanyagokra is készíthető így fémbevonat, ami szükség esetén galvanikusan tovább vastagítható. Egy oldatban kell összehozni a kiválasztandó fémet és egy közepesen erős redukálószert (leggyakrabban formaldehid) és egy stabilizátort, ami az idő előtti reakciót megakadályozza. A fémkiválásnak csak akkor szabad megindulni, ha az előkezelt, aktivált munkadarabot behelyeztük a fürdőbe. Réz, nikkel, ezüst, palládium.

Fürdő összetevői:

- Fémsó
- Redukálószer
- Puffer (pontos pH beállítása, tartása)
- Nedvesítőszer (tapadás javítása, felületi fesz. csökkentése)
- Stabilizátor (fürdő spontán bomlásának gátolása)
- Víz

33. A felület kikészítés célja, a bevonatok anyagai, a felvitel módjai.

Célja a rézfelület forraszthatóságának javítása, tartósítása, nedvesítés javítása, különösen ólommentes forrasztás esetén.

Bevonatok anyagai: nikkel, arany, palládium, ezüst.

Felvitel módjai: immerzió (ENIG, ENIPIG), redukció és olvadékba mártás (HASL).

34. Milyen a forraszthatóságot javító felületkikészítő eljárásokat ismer?

HASL (Hot Air Solder Level)

A kártyát belemártják pár másodpercre egy ónnal teli kádba majd kiemelve nagy nyomású forró levegőt (300 fok) fújatnak a kártyák felületére, ami a fölösleges ónréteget, mint egy kés eltávolítja. Így csak azokon a felületeken marad meg az ón ahol szeretnénk, a vezetőpályák és a festékréteg között nem.

Előny: könnyű művelet, javítható; jó kötéserősség; hosszú eltarthatóság; könnyű vizuális ellenőrzés Hátrány: kontaktushiány veszélye szitanyomtatáskor, egyenetlen rétegvastagság, nagy aspect ratio esetén nem alkalmas; kevésbé alkalmas fine-pitch SMT alkatrészeknél; rövidzár veszélye fine-pitch kivezetések esetén; réz beoldódás; alapos folyamatellenőrzés szükséges

- ENIG (Electroless Nikkel Immersion Gold)

Immerzióval nikkel majd arany felvitele.

Előny: sík felület; egyenletes vastagság; többszörös hőciklust elbír; hosszú eltarthatóság; jól forrasztható; alkalmas fine-pitch IC-khez

Hátrány: arany huzalkötésre nem alkalmas; drága; nikkel hulladékkezelés szükséges; nem javítható a szerelőüzemben; nem optimális a nagysebességű áramkörökhöz; ritkán előfordul a nikkel felületre jutása (hiperkorrózió)

ENIPIG (Electroless Nikkel Immersion Palladium Immersion Gold)

Előny: legjobb bevonat; jól forrasztható és bondolható; Ni és Au között Pd réteg így nincs hiperkorrózió

Hátrány: ez a legdrágább bevonat

- Immerziós Ezüst

Előny: alkalmas fine-pitch alkatrészekhez; sík felület; nem drága; gyors, könnyű művelet; nem függ a furatmérettől; javítható, újra elkészíthető a szerelőüzemben is

Hátrány: törékeny réteg, nem alkalmas press fit alkatrészekhez; nehézségek a mikroviák fémezésénél; korrózióra érzékeny

- Immerziós Ón
- OSP (Organic Solderability Preservative)

Előny: egyenletes sík felület; javítható a beültető üzemben; nem változtatja a furat méretét; gyors, könnyű művelet; olcsó; jól összefér a forrasztásgátló lakkal

Hátrány: nehéz ellenőrzés; kérdéses megbízhatóság; korlátozott újraforrasztás; érzékeny néhány oldószerre; korlátozott eltarthatóság

Szelektív ezüstözés

Ezt használják, mert az immerziós arany/nikkel drága, túlságosan összetett és kezelést igénylő eljárás, az OSP-nél pedig korlátozott a vezetőképesség.

35. A maratószerek jellemző tulajdonságai, a maratószerek csoportosítása

Jellemzőik: marási sebesség, hőmérséklet, koncentráció, függésmarási kapacitás, alámarás, szelektivitás, regenerálhatóság, egészségügyi és környezeti hatás

Csoportok: lúgos, savas

36. <u>Többrétegű NYÁK: az együttlaminált technológia lépéseinek leírása, rövid ismertetés, indoklás. (csak átmenő furatok) pl. 6 rétegű.</u>

Együttlaminált technológia:

- Kétoldalas lemezeken rétegenként a rajzolat elkészítése úgy, mint a kétoldalasnál, de furatfémezés nélkül
- Alul-felül nincs rajzolat
- Rézfelületre vékony oxidréteg
- Pakett összeállítás, sajtolás (170 fok, 15 bar, 40-60 perc)
- Fúrás, furatfémezés, rajzolat a két külső rétegre..., mint a kétoldalasnál
- Főképp átmenő furatok, lehet eltemetett vagy zsák furat
- 1. Kifúratlan kétoldalas lemez belül a hordozóval kívül a rézzel.
- 2. Maszkolás: Reziszt felvitele, exponálás, előhívás. A nem kívánt rész marad szabadon.
- 3. Maratás: Reziszt eltávolítása, a felület oxidálása
- 4. A rétegszerkezet összeállítása
- 5. Forró préselés: prepreg kikeményedik és összeköti a rétegeket
- 6. Fúrás
- 7. Redukciós réz leválasztása
- 8. Negatív reziszt alkalmazása (a rajzolat maradd szabadon)
- 9. Rajzolat galvanizálás
- 10. Maratásálló ónréteg galvanizálása
- 11. Riston fólia eltávolítása (strippelés)
- 12. Szelektív marás (a vezetőhálózatot az ón védi)
- 13. Ón réteg leoldása
- 14. Forrasztásgátló réteg felvitele (forrasztási felületek szabadon maradnak)
- 15. Felület kikészítés (tartós forraszthatóság biztosítására)

37. <u>A nagy alkatrész-sűrűségű összeköttetés (HDI) megvalósításának módjai a</u> NYÁK-gyártásban.

Szekvenciális technológiával valósítható meg. Vonalfinomság <150um. Kisebb furatátmérő, több réteg. Mikroviák használata (eltemetett és vakviák).

38. Mi a szekvenciális NYHL gyártás lényege? Milyen megoldásait ismeri?

Az alkatrészsűrűség növelése a cél (furatátmérő és csíkszélesség csökkentés, rétegek számának növelése, használatlan lyukfelület csökkentése). A rétegeket egyenként egymásra építve rakjuk össze. Előnye a kisebb méret, nagyobb sebesség, kevesebb réteg és kisebb költség. Lézeres elpárologtatás, fényérzékeny szigetelő réteg.

39. <u>A szekvenciális NYÁK gyártás lehetséges módszerei, lépései, a mikroviák</u> készítése

Lézeres elpárologtatás

Egy felépített egység; műgyantával bevont rézfólia, ezen mikrovia fúrás lézerrel. Rajzolat kialakítása fotoreziszt technikával, maratással.

Fényérzékeny szigetelő réteg

Úgy alkalmazzuk, mint a fotoreziszteket, mikrovia készítése fotózással és előhívással. Után vezető réteg kialakítása additív technikával.

Mikrovia készítése fúrással történik:

- mechanikai (korlátozott pontosság: mélységi kb. 40um, oldal kb. 50um)
- plazma
- lézer (CO2 lézer, 10,6 um, fémet nem fúrja; UV lézer, 30um)

40. Szekvenciális NYÁK gyártás; a laser-ablációs (elpárologtatás) eljárás lényege.

41. Szekvenciális NYÁK gyártás; a fényérzékeny szigetelő réteges eljárás lényege

42. A beágyazott passzív elemek alkalmazásának lényege, a megoldási módok

Lényege a rövidebb huzalozás és a méretcsökkenés megoldása. Előnyei a jobb impedancia illesztés, rövidebb jel útvonal miatt kisebb soros induktivitás, megszünteti az SM alkatrészek induktív ellenállását, csökkenti az áthallást, zajt. Megoldási módok: beágyazott vagy felületi vékonyréteg ellenállások, galvanikusan felvitt ellenállások, vastagréteg technológiával (szitanyomtatással) létrehozott ellenállás.

43. <u>A hajlékony NYÁK előnye, szerepe. A merev-hajlékony panel szokásos</u> szerkezete.

Vannak bizonyos igények, aminek kielégítésére a hajlékony nyák ad megoldást. Előnye a pontosság, a rugalmasság, a nagy hő- és tűzállóság. Szerkezete: merev-hajlékony-merev.

44. A gyártásközi és a végellenőrzés szerepe, módszerei a NYÁK gyártásban

Gyártásközi ellenőrzésű

Eszközök: fúrók, galvánfürdők, elektródok

Módszerek: vizuális, AOI (Automatical Optical Inspection), mérő automaták

45. <u>A NYÁK-ok, NYÁK tervek osztályba sorolásának célja és szempontjai (a határértékek nem kellenek)</u>

A NYÁK-okat rajzolatfinomság szerint osztályokba sorolják. A besorolást a legkisebb méret dönti el. Az osztályok száma változó.

A NYÁK tervek osztályai:

- 1. Általános bonyolultságú tervezés
- 2. Mérsékelten bonyolult tervezés
- 3. Nagy bonyolultságú tervezés
- 4. Ez az osztály a gyárthatóság határán kívül van

Szereléstechnológia

- 46. <u>Írja le a gépi szerelés részletes műveleti sorrendjét indoklással együtt, az üres NYHL beadásától a kész panel levételéig, ha egyik oldalon SM, másik oldalon TH alkatrészek vannak! (Üzemi, nagy sorozatú gyártásban) Minden lépéshez pár szavas indoklás kell, minden lépést külön sorba írjon!</u>
 - Huzalkivezetéses alkatészek beültetése, mechanikai rögzítése
 - Panel fordítása
 - Ragasztó felvitele
 - Felületszerelhető alkatrészek beültetése
 - Ragasztó kikeményítése kemencében
 - Panel fordítása
 - Hullámforrasztás, tisztítás
- 47. <u>Írja le a gépi szerelés részletes műveleti sorrendjét indoklással együtt, az üres NYHL beadásától a kész panel levételéig, ha csak egy és azonos oldalon vannak SM és TH alkatrészek! (Üzemi, nagy sorozatú gyártásban) Minden lépéshez pár szavas indoklás kell, minden lépést külön sorba írjon!</u>
 - Forrasztópaszta felvitele az A oldalra
 - Felületszerelt alkatrészek beültetése az A oldalon
 - Újraömlesztéses forrasztás
 - Huzalkivezetéses alkatrészek beültetése, mechanikai rögzítése az A oldalon
 - panel fordítása
 - ragasztó felvitele
 - ragasztó kikeményítése
 - panel fordítása, hullámforrasztás

48. <u>Milyen a helyes reflow hőprofil? Magyarázza meg az egyes szakaszokon miért pont olyan?</u>

Tipikus hőprofil folyamatának több zónája van.

- Az előfűtési zóna célja az, hogy a paneleken egyenletesen és viszonylag rövid idő alatt felfűtse.
- A második zóna (hőkiegyenlítés) folytatja az oldószerek kiszárítását, hogy megelőzzék a paszta gázosodását és esetleges fröcskölését.
- Az ömlesztési vagy csúcszónában a hőmérséklet gyorsan 20-40 fokkal az ötvözet olvadáspontja fölé emelkedik. Ekkor a forraszanyag nedvesíti a felületet és fémes kötést biztosít.
- A gyors lehűtés során a rétegnedvesítés és a rétegbeoldódás folytatódik, amíg a forraszanyag hőmérséklete az olvadáspont felett van.

49. Hol és hogyan alakul ki az intermetallikus réteg, mi a funkciója?

Két fém egy harmadikkal való összekötése (forrasztása) esetén alakul ki a két fém között, úgy hogy a forraszfém oldja az összekötendő fémek felületét és egy ötvözési folyamat indul el, mely során kialakul a fémközi elegy (intermetallikus réteg).

50. <u>A forraszpaszta felvitelének módja. Főbb paraméterei. Hibalehetőségek, azok</u> következményei

Stencilnyomtatással (tömeggyártás) vagy cseppadagolással (kisebb sorozatú gyártás) viszik fel a forraszpasztát. A stencilnyomtatás technológiája során egy stencilen (vagy más néven maszkon) kialakított lyukakon (apertúrákon) keresztül juttatjuk rá a panelen található pad-ekre a forrasztópasztát Lépések:

- o Loaderből a panel betöltése
- o A pasztázógép leszorítja a panelt
- o Kamera segítségével a megfelelő helyzetbe pozícionálja
- o Panel illesztése a maszkhoz
- A paszta a stencil egyik oldalára kerül, majd egy kés segítségével megkezdődik a paszta felvitele

Hibák:

- o A forraszpaszta beleragadása a stencilapertúrába
- Hiányos pasztalenyomat: kialakulhatnak gyenge kötések, nyitott kötések, valamint sírkő jelenség
- o Kráteres pasztalenyomat: kialakulhatnak nyitott kötések
- o Forraszpaszta fülek kialakulása: kialakulhat rövidzár (túl sok paszta a füleknél)
- o Forraszpaszta megrogyás: kialakulhat rövidzárlat (forraszszemcsék elcsúsznak egymáson)
- Elcsúszott forraszpaszta lenyomat

51. <u>Az SM alkatrészek beültetésének menete, a beültetőgép működése, az</u> alkatrészek rögzítésének módjai.

Beültetés menete:

- Alkatrész felvétele (vákuum szipkával): A gépek ezeket a szipkákat cserélni tudják az alkatrészek kialakításának, tokozásának függvényében.
- Panel rögzítése, pozícionálása: A két szélén sínek segítségével, vagy pozícionáló tüskékkel (a panel szemközti sarkaiban). Általában egyszerre használják a panel elmozdulásának megakadályozására. Ehhez a lépéshez minden gép rendelkezik egy kamerás felismerő rendszerrel, ami segít a panel helyzetét beállítani.
- A különleges alkatrészek esetében ellenőrzésre is szükség van. Pozícionálás a kamerával, majd a gép automatikusan korrigálja az eltéréseket. A szipka felveszi az alkatrész és a kamera felett átmozgatja. A kamera körüli fény segítségével minden apró részlet meghatározható az alkatrészről.

Az alkatrészek beültetési pontosságát számos tényezőtől függ, ide tartozik a mozgató tengelyek állapota, a kamera korrekciós képességétől és felbontásától, a panel rögzítésétől, valamint az előre megírt programtól.

52. <u>Hullámforrasztás: lényege, kivitelezése felület és furatszerelt alkatrészek</u> forrasztásakor. A technológia módosulása az ólommentes forraszanyagok használatakor.

Hagyományos hullámforrasztásnál az áramköri lapka teljes felülete érintkezik a folyékony forraszanyaggal. Ahol a forraszanyag találkozik forrasztható felülettel (alkatrész kivezetés, forrasztási pont) ott létrejön a forraszkötés. Szelektív hullámforrasztásnál a NYÁK lapkának csak bizonyos részei találkoznak a forrasztó hullámmal.

Az SM és TH alkatrészek közül az SM-eket alulról felragaszjuk, a TH-kat beültetjük felülről.

53. <u>Mi a folyasztószer (flux) szerepe? Hogyan alkalmazzák a különböző forrasztási</u> módszereknél

Szerepe:

- o oldja a fémoxidokat, és megakadályozza a fémek újraoxidációját
- o teret ad a forraszanyagnak
- o elősegíti a nedvesítést

Tulajdonságai:

- o kémiailag közömbös a forrasztandó fémmel és a forraszanyaggal
- o jó villamos szigetelő
- egészségre nem ártalmas, nem környezetszennyező

Összetétel:

- o gyanta (fenyőgyanta, műgyanta)
- o oldószer (alkohol, víz)
- aktiválószerek

Típusai:

- No Clean: A forrasztási művelet után a fluxmaradékot nem kell lemosni. A visszamaradt flux színtelen, villamosan nem vezető
- O Clean: A forrasztási művelet után a fluxmaradékot oldószerrel (vízzel) el kell távolítani.

54. <u>Mikor, hogyan alkalmaznak ragasztót az áramköri modulok szerelésében?</u> Melyek a ragasztók legfontosabb tulajdonságai?

A ragasztót csak mechanikai rögzítésre használjuk az SM alkatrészek szerelése közben, hogy a hullámforrasztás alatt a hullám le ne mossa az alkatrészeket a hordozóról, vagy ha TH és SM alkatrészeket is építünk be akkor a panel forgatása közben le ne essenek az SM alkatrészek. A legfontosabb tulajdonságaik a térhálósítási idő, a tárolási időintervallum és a kötés bonthatósága.

55. <u>A reflow forrasztás menete, körülményei. A lehetséges hibaforrások. Lehet-e</u> csak reflow-val forrasztani, ha mindkét oldalon van SM alkatrész? Miért?

A forrasztópaszta felvitele majd az alkatrészek beültetése után a forraszanyag megömlesztése (mikrokötések létrehozása) következik. Lényegében a forraszanyagot újból megömlesztik, ezért nevezik reflow forrasztásnak. Alapvető célja, hogy magas minőségű forrasztott kötést biztosítson az alkatrészek kivezetései és a panel megfelelő kontaktusai között. Lehet, ezt hívják dupla reflownak.

Hibaforrások:

- Alacsony vagy nem elég hosszan tartott csúcshőmérséklet (hibás kötések, zárlat)
- Magas csúcshőmérséklet (hősokk)
- o Rövid hőntartás (alkatrész elmozdulások: sírkőképződés, elúszás)
- o Túl meredek felfűtés a csúcshőmérsékletig (forraszgolyók kialakulása→zárlat)
- Túl meredek lehűtés (repedések a kötésekben)

56. Hogy alakul ki a jó forrasztott kötés? Melyek a feltételei?

Ezt úgy lehet elérni, hogy a panel kontaktusokat, a kivezetőket és a forrasztópasztát együttesen felmelegítjük az ötvözet olvadáspontja fölé úgy, hogy a forrasztás mindenhol átalakuljon homogén szerkezetté. Feltételei az eredményes fűtésirányítás és a fűtési variációk megfelelő alkalmazása különböző panelekre.

57. Melyek a fő forrasztási típusok, mikor melyiket használjuk, miért?

- Reflow forraasztás
 - SM alkatrészekhez
- Hullámforrasztás
 - SM és TH alkatrészekhez is
- Kézi forrasztás
 - SM és TH alkatrészekhez is

58. Milyen módszereket ismer a forrasztás jóságának ellenőrzésére?

- Vizuális
- Gépi (AOI, X-ray)

59. Milyen módszereket alkalmaznak a szerelt panel minőségének ellenőrzésére?

Tesztelés repülő tűs vagy tűágyas teszterrel:

- o alkatrészteszt: ellenőrzött alkatrészek %-a
- o funkcionális teszt: ellenőrzött funkciók száma

Hibrid

60. Hibrid áramkörök hordozói, fajták, követelmények

Hordozó: szigetelőanyag (üveg, kerámia, zafír, kvarc)

Fajtái: vékony és vastagréteg HIC-k

Követelmények:

- Mechanikai tartás
 - o nagy szilárdság kis vastagság esetén is
 - o jó darabolhatóság
 - o egyenletes lemezvastagság, síklapúság, felületi érdesség
- Villamos szigetelés
 - felületi, térfogati → alkáliszegény anyagok
- Hőelvezetés
 - terhelhetőség
- Hőtágulás
- o illeszkedjen a réteghez, TK romolhat
- Felületi tisztaság

61. A szabad úthossz fogalma, szerepe a gőzölési folyamatban?

Megadja, hogy a párologtatott, porlasztott részecske mekkora távolságot tesz meg az adott környezetben, anélkül, hogy ütközne egy másik részecskével.

A megfelelő vékonyréteg kialakításához szükséges, hogy a gőzfázisba jutott anyag lehetőleg ütközés nélkül jusson el a hordozóig. Ennek feltétele, hogy a szabad úthossz nagyobb legyen a forrás-hordozó távolságnál. A nyomás csökkenésével nő a szabad úthossz.

62. <u>Ismertese a vákuumtechnikai rétegleválasztások típusait! Melyek a vákuumtechnikai eljárások főbb előnyei, hátrányai?</u>

Típusai:

- Porlasztás (katódporlasztás, reaktív porlasztás, magnetronos porlasztás)
- Párologtatás, gőzölés (vákuumpárologtatás, elektronsugaras gőzölés, fűtőszálas gőzölés, indukciós párologtatás, lézeres párologtatás)

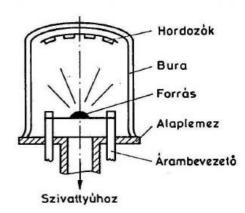
Előnyük a tisztaság.

63. <u>A vákuumpárologtatás alapja, a berendezés ismertetése, a</u> rétegvastagság követésének módjai

Vákuumpárologtatás

A vákuumpárologtatás lényege, hogy ritkított térben a leválasztani kívánt anyagot Joule-hő, elektronnyaláb, vagy lézer energiája segítségével gőzfázisba hozzuk és az a hordozó felületén kondenzálódik, kialakítva rajta a vékonyréteget.

A megfelelő vékonyréteg kialakulásához szükséges, hogy a gőzfázisba jutott anyag lehetőleg ütközés nélkül jusson el a hordozóig. Ennek feltétele, hogy a szabad úthossz nagyobb legyen a forrás hordozó távolságnál.



A rétegvastagság számítható és mérhető.

64. Az elektronsugaras gőzölés elve, előnye a csónakból történő gőzöléssel szemben

Ennek lényege, hogy a magas olvadáspontú, kis diffúziós állandójú fűtőtégelyben lévő forrásanyagot elektronsugárral fűtjük.

Előny:

- o magasabb hőmérséklet → nagyobb olvadáspontú anyagok gőzölhetőek vele
- o kisebb felületről
- o csak a saját anyaggal érintkezik → tisztább
- o nagyobb rétegnövekedési sebesség

65. A katódporlasztás elve, változatai

A katódporlasztás alapja egy ritkított térben, két elektróda között létrehozott önfenntartó villamos kisülés, plazma létrehozása. Ebben a ritkított térben az elektronok felgyorsulnak és ütköznek a - többnyire nemesgáz atomokkal, amelyekről további elektronokat szakítanak le. Az így keletkezett pozitív ionok az erőtér gyorsításának hatására a katódba csapódnak és amennyiben energiájuk nagyobb a kötési energiánál, atomokat löknek ki onnan. Az így kilökött atomok a katód alatt elhelyezkedő anódon lévő hordozóra csapódnak. A folyamat feltétele a plazma létrejötte.

Változatai:

- reaktív: A nemesgáz mellett olyan gáz bekeverése a vákuumtérbe, amely a targetből kilépő atomokkal reagál és beépül a rétegbe (pl.: TaN, Si3N4, Al2O3).
- rádiófrekvenciás porlasztás: Szigetelőanyagok porlasztására használják. A target nem töltődik fel, potenciálja folyamatosan negatív. Hátránya, hogy a katód anyaga is fogy.

66. <u>Átlátszó vezető rétegek; Anyagok, tulajdonságok, alkalmazási</u> területek

- Kijelzők nézeti oldalán

- R: 10ohm...1kohm

Fényáteresztés: ~80%

Fotolitografálható

- Anyag: ITO: In2O3 SnO2

67. A vastagréteg paszták fő alkotói, szerepük a réteg kialakulása során

Komponensek:

- Funkcionális anyag
- Végleges kötőanyag (üvegkerámia)
- Átmeneti kötőanyag
- o Szerves oldószer (viszkozitás, tixotrópia)
- Speciális adalékok

68. <u>Melyek a vékonyréteg és a vastagréteg ellenállásanyagok fő</u> tulajdonságai, milyen anyagokat használnak?

- funkcionális fázis: fém, fém-oxid
- üvegfázis nagyobb arányban
- R nő az üvegfázis növelésével
- Pasztasorozat dekádonként 10ohm-10Mohm, köztesek kikeverhetők
- összetétel: vezető (20%), kötőanyag (50%), oldószer (27%)

69. <u>Melyek a vékonyréteg és a vastagréteg vezetőanyagok fő tulajdonságai, milyen anyagokat használnak?</u>

- Követelmény: jó vezetőképesség, kompatibilitás a többi pasztával, tapadás a hordozóhoz, köthető és forrasztható legyen
- Beégetéskor a fémes és az üveges fázis szétválik → javul a tapadás és a vezetés is
- Üvegtartalom kb. 20-30%
- Anyagok: Pd-Ag, Pt-Ag, Pd-Au, Pt-Pd-Ag, Au, Cu

70. <u>A rétegellenállások értékbeállításának elve és gyakorlati kivitelezése.</u>

R=ró*(I/w+s)

Gyakorlatilag csak ellenállás. Utólag R csak növelhető. A képletből bármelyik tag változtatható, de a leggyakoribb az I növelése (s csökkentése). w csökkentése Ta, TaN anódos oxidálás. Lézeres értékbeállítás:

- R pálya hosszának növelése
 - folyamatos: bevágás az R felületbe
 - szakaszos: rövidzárak átvágása
- o beállítás alatt folyamatos R mérés
- 71. <u>Milyen lépések során tudjuk elérni, hogy egy adott (pontos) értékű</u>
 <u>ellenállást készíthessünk? A tervezéstől a gyártás befejezéséig a fő</u>
 <u>fázisok.</u>

72. Multichip modulok: felépítés, típusok, technológia.

Felépítés:

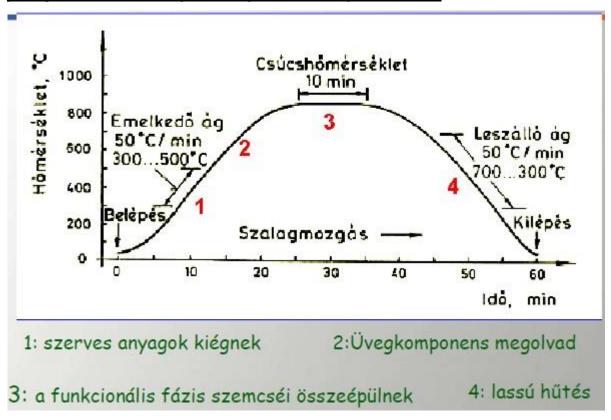
- közös hordozón több IC chip
- integrált vezetőhálózat
- beágyazott passzív elemek

Típusok:

- MCM-L (laminált): főképp NYÁK technológiával
- MCM-C (kerámia): vastagréteg technológia (magas és alacsony hőm.-en égetett)
- MCM-D (deposited): vékonyréteg technológiával

73. Lehet-e több réteg egymás fölött a vastagréteg HIC-ben? Miért?

74. <u>Ismertesse a vastagréteg beégetésére alkalmazott hőprofilt, jellegzetes tartományait, a lejátszódó folyamatokat!</u>



75. A vastagréteg HIC előállításának lépései. Csak vezető és ellenálláshálózat készül, a lépések sorrendben a tiszta hordozótól a tokozásig, ha ismétlődés van, azt is.

Félvezetők

- 76. A Si szelet előállításának fázisai a nyersanyagtól kezdve. A lépések lényege 1 –1 mondatban, kémiai egyenletek nélkül.
 - Szeletelés
 - Feszültségcsökkentő hőkezelés
 - Él lekerekítés, polírozás
 - Szelet vékonyítás
 - Szelet polírozás (CMP: Mechanikai: kvarcpor szuszpenzió, Kémiai: savas és lúgos maratás felváltva)
- 77. <u>Milyen marási módszereket ismer a félvezető, és a MEMS</u>
 <u>technológiában? Hogyan szabályozható a marási profil?</u>
 - Izotrop marás: Nagy felületről a felső réteg eltávolítása (pl. tisztítás, fotoreziszt eltávolítás)
 - Anizotrop marás: Maszkon keresztül nagy felbontású, pontos minta készítése. (pl.
 IC, optikai, optoelektronikai elemek, MEMS)

Jól szabályozható az RF teljesítmény és a nyomás.

- 78. <u>Milyen az anizotróp, izotróp marási profil? (félvezető, MEMS) Mitől</u> függ, hogy milyen alakul ki?
- 79. <u>Milyen követelmények vannak a félvezető litográfiában a megvilágító fénnyel szemben? Milyen nehézségek jelentkeznek a rajzolatfinomság növelésekor?</u>
- 80. Hogyan történik a maszkolás a félvezető technológiában?
 - maszk: nagyított, krómdioxid, üveghordozón
 - pl. az oxidáció is maszkol

81. A plazmamarás alapjai, felhasználási területei.

- Vákuumtérbe vezetjük a kiválasztott gázt
- RF elektromágneses térben koronakisülés
- Nagyon reakcióképes termékek (ionok, szabad gyökök, fotonok, semleges részecskék, molekulák pl. ózon)

Felhasználás:

- Anizotróp marás
- Izotróp marás

82. <u>Mi a szilícium-dioxid (SiO2) szerepe a félvezető technológiában?</u> <u>Hogy készíthető, hogy lehet eltávolítani?</u>

Kettős szerep:

- Technológiai: maszkol
- Áramköri: szigetel a felületen, MOS tranzisztorokban

Készíthető nedves (vízgőz jelenlétében) és száraz módon is, kb 1000 fokon.

Eltávolítása oxidmarással lehetséges (plazmamarás, izotróp és anizotróp marás).

83. <u>Ismertesse a CVD eljárás lényegét, célját, módozatait! Hol, milyen rétegek leválasztására használható?</u>

Az epitaxiális rétegnövesztés egyik módszere. Kémiai gőzfázisú leválasztás. Vákuumban 500-1000 fok között valamilyen kémiai eljárással bontják le majd építik fel az alkatrészre a felületi réteganyagot. Kemény, kopásálló rétegeket, DLC réteget és mesterséges gyémánt bevonatot is készítenek ezzel a technológiával. A reakciót többféleképpen lehet aktiválni: kis nyomású plazmával, lézersugárral. Aszerint különböztetjük meg a különböző módjait, hogy a bevonat gőzállapotba hozása párologtatással vagy porlasztással történik-e, illetve a reakciókat csak hőközlés vagy plazmaaktivitás is segíti-e.

84. Rajzolatkialakítás a hibrid és a félvezető technológiában: a lift-off technika és a kettős maszkolás ismertetése.

Lift-off (fordított rezisztmaszkos eljárás):

- A tiszta hordozón fotorezisztből alakítjuk ki a negatív ábrát
- Erre gőzöljük (porlasztjuk) a réteget

Kettős maszkolás:

- Reziszt/SiO2/Si
- Megvilágítás mély UV fénnyel (step & repeat)

85. <u>Milyen eljárásokat ismer a félvezetők adalékolására? Milyen lesz az adalékok mélységi eloszlása?</u>

Eljárások:

- diffúzió
- implantáció

86. <u>Mi a diffúziós adalékolás lényege, milyen megoldási lehetőségeket</u> ismer? Milyen a kialakult adalék-eloszlás?

A p és n típusadalék bejuttatása a szerkezetbe, meghatározott koncentrációban és mélységi eloszlásban. A felülethez juttatott diffuzáns atomok (P, B) kb. 1000 fokon bediffundálnak a felületi rétegbe. Forrása lehet gáz, folyadék, szilárd.

87. <u>Mi az implantáció szerepe, hogyan történik (berendezés rajz nem</u> kell), mi az előnye, hátránya a diffúzióval szemben?

Gyorsított ionok belövése az anyag felületi rétegébe.

Előnyei:

- pontosabb, finomabb rajzolat
- élesebb oldalirányú kontúr
- felszín alatti réteg is létrehozható vele

Hátrányai:

- rombolja a szerkezetet (hőkezeléssel rendezhető)
- kevésbé termelékeny

88. Mit jelent az epitaxiális rétegnövesztés? Milyen módszereit ismeri?

Az alaprács egykristályos szerkezetét, orientációját folytatja az új réteg. Homo: azonos anyagból, de pl. más adalékolással. Hetero: más anyag, de nagyon hasonló rácsállandóval pl.: GaAlAs réteg GaAs hordozón.

Módszerek:

- Gázfázisú (CVD)
- Folyadékfázisú
- Molekulanyaláb (MBE)

89. <u>Mi az MBE (molekulasugár epitaxia) lényege, mi az egyedülálló tulajdonsága?</u>

- Több forrás (Knudsen cella), nagyon pontosan szabályozható atom vagy molekulasugár
- Ultranagy vákuum, ~10^-10 mbar → nagy tisztaság
- Folyamatos ellenőrzés lehetősége rétegépülés közben
- Lassú rétegnövekedés, akár monomolekulás rétegrendszer is előállítható, pl. szuperrács lézerdiódához
- Lassú eljárás, egyszerre csak egy szelet
- Rétegnövekedés ~1 nm/perc

90. <u>Melyek a 45nm-es technológia során alkalmazott fontosabb új megoldások?</u>

- Nagy dielektromos állandójú HfO2 alapú gate szigetelő SiO2 helyett
- Fém elektródák használata poli Si helyett
- Feszített Si struktúra (SiGe)